

フォトニクスセンター共用装置一覧 2021年度

装置G	装置名	設置場所	講習会 有無	グループ利用料 (年間)	装置別利用料 (時間)	消耗品負担 有無
設計	構造設計ソフト	P3-205	×	¥13,000	—	×
	光学系設計ソフト	P3-205	×			×
微細加工	ワイヤーボンダー	P3-517	○	¥10,000	—	×
表面評価	表面段差計	P2-429	○	¥10,000	—	×
	レーザー干渉計	P2-434	×			×
光学測定	倒立顕微鏡	P2-430	×	¥20,000	—	×
	マイクロプレートリーダー	P3-309	○			× (*1)
	デジタルマイクロスコープ	P2-430	×			×
	マルチチャンネル分光器	P2-434	○			×
	紫外可視近赤外分光光度計	P2-430	○			× (*1)
分析	サーマルサイクラー	P3-309	×	¥15,000	—	× (*1)
	ドラフト	P3-339	×			×
	ゼータ電位計	P3-309	○			× (*1)
	ポテンショスタット	P3-309	×			×
機種毎	3Dプリンター	P3-205	○	—	¥3,500	○
	エリプソメーター	P2-430	○	—	¥1,500	×
	共焦点レーザー顕微鏡	P3-309	○	—	¥1,500	×
	マスクレス露光装置	P3-517	○	—	¥2,500	× (*2)
	集束イオンビーム加工・観察装置	P2-429	○	—	¥3,800	×
	コンパクトスパッタ	P2-429	○	—	¥2,200	×
	広視野ラマン顕微鏡	P3-309	○	—	¥2,200	×
	レーザーラマン顕微鏡	P3-309	○	—	¥2,800	×
	SEM-EDX	P2-430	○	—	¥2,200	×
	走査型プローブ顕微鏡	P3-309	○	—	¥2,500	× (*3)
	プラズマクリーナー	P3-517	○	—	¥2,200	×
	蛍光分光光度計	P3-309	○	—	¥2,200	× (*1)
	顕微FT-IR	P3-309	○	—	¥2,700	×
その他 申請不要	スピコーター	P3-517	×	—	¥0	×
	マイクロトーム	P2-430	×	—	¥0	×
	プラチナコーター	P2-430	×	—	¥0	×
	超純水製造装置	P3-309	×	—	¥0	×
	製氷機	P3-309	×	—	¥0	×
	分析天秤	P3-309	×	—	¥0	×
	pH測定器	P3-309	×	—	¥0	×
	オシロスコープ	P3-205	×	—	¥0	×
	実体顕微鏡	P2-430	×	—	¥0	×

(*1):セル等、持参のこと (*2):レジスト持参のこと (備え付けレジストもあり) (*3):カンチレバー持参のこと